

## ساخت ترکیب نانو چند لایه ای $Ti_2AlN$ از طریق کندوپاش مغناطیسی DC

محمد رضا حنطه زاده<sup>\*</sup> و سعیده گودرزی

مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

### چکیده

شیوه و چگونگی ساخت فاز  $Ti_2AlN$  در این مقاله مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است. لایه های نازک  $Ti_2AlN$  یکی از اعضای گروه فاز  $M_{n+1}AX_n$  (M: فلز واسطه؛ A: عنصر گروه A؛ X: کربن و یا نیتروژن؛ n=1 و 2)، با خواص فوق العاده سرامیکی - فلزی می باشد، رسوب گذاری لایه های نازک این نیترید سه تایی به وسیله کندوپاش مغناطیسی dc از یک هدف ترکیبی  $Ti-Al$  در فضای مخلوط گازی  $Al/N_2$  روی لایه های  $Ti_2AlN$  حاصل شده و در ادامه خصوصیات سطح نمونه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

\* عهده دار مکاتبات

## مقدمه:

فازهای  $M_{n+1}AX_n$  (MAX) یک خانواده بزرگ از کربیدها و نیتریدهای نانو لایه ای شش وجهی هستند که در آن  $M$  یک فلز واسطه در جدول تناوبی (فلزاتی که در سمت چپ قسمت مرکزی جدول تناوبی قرار دارند، مانند تیتانیوم و وانادیوم)،  $A$  یک عنصر گروه A (معمولًا IIIA و IVA) و  $X$  هم کربن و یا نیتروژن می باشد. ساختار فازهای MAX به این صورت است که قطعه های هشت وجهی در گوشه های ساختار قرار دارند ( شبیه ساختار سنگ نمک) و اتمهای کربن یا نیتروژن قسمت های میانی هشت وجهی را که بین لایه های تنگ پکیده از اتمهای فلز واسطه قرار دارند، اشغال کرده اند که خود این لایه ها هم به وسیله لایه های عنصر A از یکدیگر جدا شده اند. طرز قرارگیری لایه ها و اتمها به این شکل است که در فاز ۲۱۱ لایه سوم، در فاز ۳۱۲ لایه چهارم و ... شامل اتمهای A می باشد<sup>(۱)</sup>. نتایجی از ترکیبات حجمی فازهای MAX توسط دکتر بارسوم<sup>۱</sup> منتشر شده است که بیان می کند تا به امروز پنجاه عضو از این مواد شناخته و ترکیب شده اند<sup>(۲)</sup>. به علت پیوندی که بین اتمهای لایه A و ترکیبات دو تایی M-X وجود دارد (پیوند A-M-X با  $M_{n+1}AX_n$ )، فازهای MAX رفتاری مشابه این ترکیبات دوتایی از خود نشان می دهند. این رفتار شامل: سختی بالا، پایداری ترمودینامیکی در دمای بسیار بالا و رسانایی خوب حرارتی و الکتریکی می شود. از آنجایی که پیوند بین اتم های M و A نسبتاً ضعیف است، خواص مکانیکی آنها به شدت متغیر و ناهمسانگرد است. مکانیزم تغییر شکل این فازها به وسیله تشکیل باندهای چین و شکنی<sup>۳</sup> از طریق ایجاد، سُر خوردن و مرتب شدن نابجاییها<sup>۳</sup> روی صفحه اصلی در محل مرزهای باند های شکنی توجیه می شود.

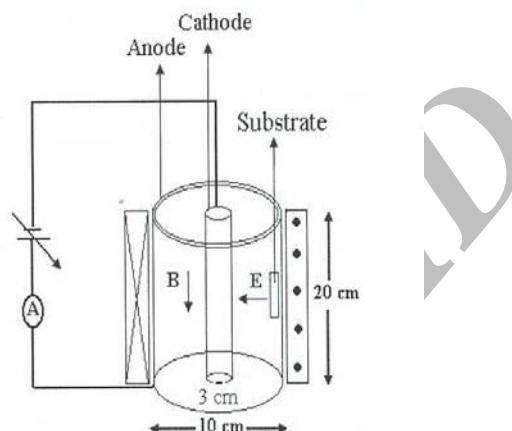
در نتیجه آن فازهای MAX به شدت قابل ماشین کاری، نسبتاً نرم و انعطاف پذیر بوده و مقاومت غیر عادی در برابر آسیب از خود نشان می دهند. در سال ۱۹۶۳ برای نخستین بار ترکیب حجمی توده هایی با فاز  $M_{n+1}AX_n$  با به دست آوردن ترکیب  $Ti_2AlN$  توسط جیتشکو<sup>۴</sup> و دیگران صورت پذیرفت<sup>(۳)</sup>. در سال ۱۹۸۴ سیستم سه تایی- $Ti-N$  توسط شوستر و بور<sup>۵</sup> مورد بررسی قرار گرفت<sup>(۴)</sup>. در بین نیتریدهای MAX کلاً دو ترکیب  $Ti_2AlN$  و  $Ti_4AlN_3$  وجود دارد. در ابتدا فاز  $Ti_3Al_2N_2$  را به صورت  $Ti_4AlN_3$  تصور می کردند اما سطح مقطع عرضی از تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)<sup>(۵)</sup> خلاف آن را ثابت کرد<sup>(۵)</sup>. در جای دیگر با استفاده از محاسبات تئوری وجود فاز شبه پایدار  $Ti_3AlN_2$  هم اثبات شد<sup>(۶)</sup>. برای تشکیل لایه های نازک کربیدی MAX با استفاده از روش کندوپاش، هم هدف عنصری و هم هدف مرکب به کار میروند اما برای تولید نیترید های MAX تنها هدف ترکیبی استفاده میشود. اگر غیر از این می بود، فرایند بسیار کند صورت می گرفت. به همین خاطر، جوالسن<sup>۷</sup> و دیگران لایه های تک کریستال  $Ti_2AlN$  را از طریق کندوپاش مغناطیسی dc از یک هدف مرکب  $2Ti:Al$  روی

<sup>1</sup> - Barsoum<sup>2</sup> - kink and shear bands<sup>3</sup> - dislocation<sup>4</sup>- Jeitshko<sup>5</sup> - Schuster and Bauer<sup>6</sup> - Transition Electron Microscopy<sup>7</sup> - Joelsson

زیر لایه های (۱۱۱)  $MgO$  در دمای رسوب گذاری  $830^{\circ}C$  درجه سلسیوس تولید کردند<sup>(۷)</sup>. به تازگی نیز بکرز<sup>۱</sup> و دیگران به همین گونه برای دمای زیر لایه پائین تری (در حدود  $690^{\circ}C$  درجه سلسیوس) این کار را انجام دادند<sup>(۸)</sup>.

### جزئیات آزمایشگاهی

رسوب لایه های نازک  $Ti_2AlN$  در یک دستگاه کندوپاش مغناطیسی dc دایروی (شکل ۱) انجام پذیرفت. سیستم از دو استوانه هم محور، کاتد (استوانه داخلی) و آند (استوانه خارجی) تشکیل شده است. قطر استوانه داخلی و خارجی به ترتیب،  $3\text{cm}$  و  $10\text{cm}$  و ارتفاعشان  $20\text{cm}$  است.



شکل ۱: نمایی از سیستم کندوپاش مغناطیسی dc استفاده شده

در آزمایش فوق از یک هدف مرکب Ti-Al استفاده کرده ایم؛ یک استوانه از جنس تیتانیوم که یک سیم نازک آلومینیومی به قطر  $2\text{mm}$  پیرامون آن پیچانده شده بود. برای انجام عمل رسوب گذاری، گاز Ar و  $N_2$  (با خلوص  $99/9999$ ) را به نسبت  $15$  به  $1$  مخلوط کردیم، به درون محفظه فرستادیم؛ تحت شرایط جدول شماره  $۱$ ، رسوب گذاری لایه ها روی زیر لایه هایی از جنس شیشه، تیتانیوم و سیلیسیوم انجام شد. قبل از شروع کار نمونه ها به وسیله دستگاه پولیش، سطحشان کاملاً صاف و صیقلی شده، سپس با دستگاه تمیز کاری مافوق صوت<sup>۲</sup> (در محیط الكل و استن) کاملاً تمیز شدند.

جدول ۱: شرایط رسوب گذاری

فاصله هدف تا زیر لایه	mm <sup>۳۰</sup>
جنس زیر لایه ها	تیتانیوم، سیلیسیوم و شیشه
فشار پایه	$5 \times 10^{-5}$
فشار نهایی	$3 \times 10^{-2}$
جریان پلاسمما	Ma <sup>۲۰۰</sup>
ولتاژ محفظه	v <sup>۵۰.۳</sup>
زمان رسوب گذاری	h - 1 h. <sup>۵</sup>

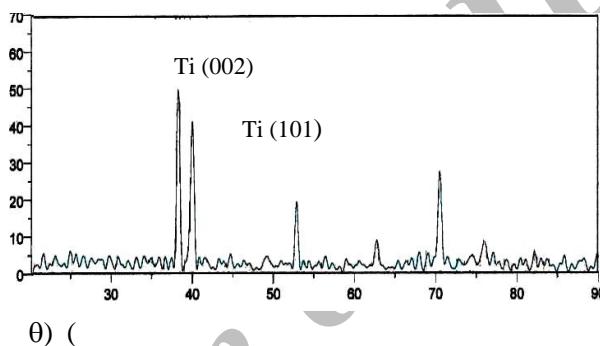
<sup>۱</sup> - Beckers

<sup>۲</sup> - ultrasonic

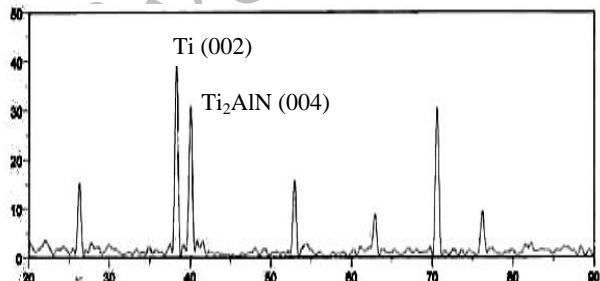
ساختار لایه ها با استفاده از پراش اشعه X در دستگاه SEIFERT XRD 3003 PTS با چشمۀ Cu K $\alpha$  در دستگاه SEIFERT XRD 3003 PTS با چشمۀ  $\lambda = 0.451 \text{ nm}$ ) تعیین گردید. آنالیز سطح را نیز با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM<sup>۱</sup>) انجام دادیم.

### نتایج آزمایشگاهی

با توجه به پیک های موجود در نمودارهای XRD به دست آمده از فازهایی که به مدت ۳۰ دقیقه لایه نشانی شدند، تشکیل فاز کریستالی Ti<sub>2</sub>AlN برای ما مشخص نشد و به نظر می رسد ساختارها حالت آمورفی داشته باشند. پیکهای موجود در شکل ۲ مربوط به زیر لایه Ti بسبلوری می باشد. لذا به وسیله عمل آنیل<sup>۲</sup> (بازپخت) و حرارت دادن نمونه ها، سطح آمورفی نمونه ها به حالت کریستالی تغییر داده شد.



شکل ۲: نمودار پراش اشعه X از لایه Ti<sub>2</sub>AlN coat روی زیر لایه Ti در مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق



شکل ۳: نمودار پراش اشعه X از سطح Ti<sub>2</sub>AlN بازپخت شده در دمای ۴۵۰ درجه سانتی گراد، نشانه شده روی زیر لایه Ti در مدت ۱ ساعت با توجه به شکل ۳، از بازپخت نمونه ای که به مدت ۱ ساعت سلسیوس روی زیر لایه Ti نشانی شده بود و سپس به مدت ۱ ساعت در دمای ۴۵۰ درجه در کوره حرارت داده شد، ساختار Ti<sub>2</sub>AlN (۰۰۴) به دست آمد. در شکلهای ۴، ۵ و ۶ پستی و بلندی های موجود در شکلهای میکروسکوپ AFM<sup>۱</sup> حاکی از رشد اندازه دانه ها و تشکیل لایه های جدید است. واضح است که سطح نمونه با زیر لایه سیلیسیوم از سایر نمونه ها مسطح تر است. به عبارت دیگر لایه های دیگر دانه درشت تر هستند.

<sup>۱</sup> - Atomic Force Microscopy

<sup>۲</sup> - annealing

## بحث و نتیجه گیری

نتایج به دست آمده از رشد لایه ها بر روی زیر لایه های مختلف نشان می دهد که نمونه سیلیسیوم به عنوان زیر لایه از نظر کیفیت سطح لایه، بهتر از نمونه های دیگر می باشد. البته بخشی از این ناصافی مربوط به ناصافی سطح زیر لایه است. هرچند که لایه انباست شده روی سطح Ti دارای دانه بندی بزرگتر، روی سطح سیلیسیوم کوچکتر و بروی سطح شیشه حالت میانی دو سطح دیگر می باشد. نتایج XRD نشان می دهد که لایه های انباست شده، در دمای اتاق (که دمای اولیه انباست است) ساختار کریستالی ندارند و به نظر می رسد که حالت آمورفی داشته باشند که با انجام فرایند حرارتی، حالت کریستالی آنها ظاهر می شوند.



شکل ۴: تصاویر AFM از سطح  $Ti_2AlN$  روی زیر لایه تیتانیوم



شکل ۵: تصاویر AFM از سطح  $Ti_2AlN$  روی زیر لایه شیشه



شکل ۶: تصاویر AFM از سطح  $Ti_2AlN$  روی زیر لایه سیلیسیوم

**References:**

- 1- Barsoum, M. W. and El-Raghy, T., *J. Am. Ceram. Soc.*, **79**, 1953 (1996).
- 2- Barsoum, M. W., *Prog. Solid Stat. Chem.*, **28**, 201(2000).
- 3- Jeitschko, W., Novotny, H. and Benesovsky, F., *Monatsh. Chem.*, **94**, 1198 (1963).
- 4- Schuster, J. C. and Bauer, J., *J. Solid Stat. Chem.*, **28**, 201 (2000).
- 5- Barsoum, M. W., Farber, L., Levin, I., Procopio, A.. and Berner, A., *J. Am. Ceram. Soc.*, **82**, 2545 (1999).
- 6- Holm, B., Ahuja, R., Li, S. and Ljohansson, B., *J. Appl. Phys.*, **91**, 9874 (2002).
- 7- Joelsson, T., Horling, A., Brich, J. and Hultman, L., *J. Appl. Phys. Let.*, **86**, 111913 (2005).
- 8- Beckers, M., Schell, N., Martins, R. M. S., Mucklich, M., Moller, W. and Hultman, L., *J. Applied Physics*, **99**, 034902 (2006) .